Numerical simulation for improving nano-focusing performance

of femtosecond plasmon pulses with gold taper structures

片野 利佳 (B4), 小島 康裕 (M1), 正木 雄太 (M2)

Rika Katano, Yasuhiro Kojima, Yuta Masaki

Abstract

In this report, we design various gratings on a metal Au tapered tip with FDTD simulation to improve intensity of 1500-nm localized femtosecond plasmon pulses at the tip apex. We numerically reveal the improvement with an ideal wave front of the incident femtosecond laser pulses at the rating and a curved grating.

1. はじめに

回折限界以下のサイズにプラズモンを集光する 手法として、金テーパーチップを用いたナノ集光が 注目されている. 我々は, 昨年度, 励起光にフェム ト秒レーザパルスを用いることで、このナノ集光プ ラズモンパルスを用いてチップ先端サイズの空間 分解能約 20 nm で選択的 CARS 計測を行い, カー ボンナノチューブの THz 分光イメージングに成功 している[1]. 金テーパーチップへの表面プラズモ ンポラリトン(SPP)の励起は、集光イオンビームで 加工した回折格子を介して行うが, Schmidt らは集 光効率を上げるために回折格子の形状を整形する 案や励起光波面をテーパーの曲率に沿うように調 整する案を報告している[2]. 実際藤間等は, 空間光 変調器(SLM)を用いた波面整形により著しい集光 強度の増加を実現した.本研究では、平面波入射に おいても SPP が効率よく理想的にチップ先端に集 光するような回折格子の形状, さらにはより広帯域 な SPP パルスを励起できる形状を設計するために, FDTD 法を用いたシミュレーションを行った.

2. 回折格子の設計

ここでは、本研究に用いた金プローブの回折格子 のパラメータの最適な値を求めるために行ったシ ミュレーションについて述べる. プローブの媒質は 加工しやすさや化学的な安定性を考え、金を用いた. 金プローブの先端角は 15°,先端から最初の溝まで の距離は 15 µm,最後の溝から終端までの距離は 3 µm である.励起光の中心波長は今後長波長域での プラズモン実験を想定して 1500 nm とし、パルス 幅 10 fs と設定した.集光位置は先端から 20.91 µm, スポット直径は断らない限り 4.575 µm, NA=0.2 で ある.測定点は金プローブの先端とした.励起光の 波長と同じ 1500 nm となるように回折格子の構造 パラメータを求めた.Fig.1(a)に設計したシミュレ ーションモデルの構造とパラメータの定義,(b)に 励起光源を示す.



Fig.1(a) Structure of taperd Au probe



(b) Spectrum of excitation light source

(i) 回折格子の溝の周期の決定

回折格子の周期は, Braggの回折格子の条件より 以下の式で表される. 左辺の第1項が伝搬する表面 プラズモンの項, 右辺の第1項が回折格子に関する 項, 第2項は入射光の表面プラズモンの伝搬軸方向 への波数ベクトルである.

 $K_{spp} = K_{in}sin\theta + K_P$ 上式は以下のように変形できる.

$$\frac{\omega}{c} \sqrt{\frac{\varepsilon_1 \varepsilon_2}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2}} = \frac{2\pi}{\lambda} \sin \theta_{in} + \frac{2\pi}{P}$$

(ii)回折格子の溝幅の決定

回折格子の溝幅wは周期に対して1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 2/3, 1, 4/5倍の値を用い, 溝の深さdは 300 nm, 溝の本数nは6本を用い, それぞれモデルを作 成し, 先端におけるパワー密度を測定した結果を Fig.2 に示す. Fig.2 より, 溝幅wはパワー密度が最 大となる 566 nm と決定した.



Fig.2 Dependence of focused SPP power as a function of width of groove

(ⅲ) 回折格子の溝の深さの決定

回折格子の溝の深さ*d*を 100,200,300,400 nm と変 化させ,溝の本数nは6本を用い,先端におけるパ ワー密度を測定した結果をFig.3に示す.Fig.3より, 溝の深さ*d*はパワー密度が最大となる 300 nm と決 定した.



Fig.3 Dependence of focused SPP power as a function of depth of groove

(iv) 回折格子の溝の本数の決定

回折格子の溝の本数nを 1~7 本まで 1 本ずつ増 やしたモデルをそれぞれ作成した. 結合効率とスペ クトル幅を Fig.4 に示す.



Fig.4 Coupled efficiency and spectrum of width

Fig.4 より,結合効率は回折格子の溝の本数が増えるにしたがって線形に増加し,しだいに飽和することが分かった.また,今回の励起光源のスポット径は4.575 µm であることも考慮し,回折格子の溝の本数は6本とした.

次に, 今回求めたパラメータを用いた金テーパーに おいてナノ集光が起きているか確認するためのシ ミュレーションを行った.励起光源は波長 1500 nm の CW を用い,先端に至るまでの表面プラズモン 強度を測定した. その結果を Fig.5 に示す.



Fig.5 SPP intensity along Au taper propagation.

Fig.5 より,先端にいたるまでに断熱的な集光,ナ ノ集光が出来ていることが確認できた.今回はこの モデルを基本形とし,さらなる高効率なプローブの 形状の設計を行った.

次に,設計した直線型回折格子における入射ビー ムのNA との関係を示す.励起光パルスは三番めの 回折格子に集光の中心をセットしたモデルとコリ メートしたビームの 二種類を用いた. その結果を Fig.6 に示す.



Fig.6 SPP intensity

コリメートしたビームでも広帯域で結合できるこ とが確認できた.

このことから,回折格子で広帯域な結合が実現し ているのは,集光パルスの NA による効果ではなく, 回折格子の溝数が少ないので狭帯域な Bragg 条件 が達成されず,効率は低いが広帯域で結合できてい るのだと予想される.

今回用いた溝の本数は 6 本であるが,溝の本数 n を増やした場合 (n=9,12) 結合帯域への影響を調べ るためにシミュレーションを行った. 本数の増加 に伴い,回折格子の全体のサイズは順次大きくして いる.同様に,回折格子全体に当たるように照射す るビームは大きく設定したが,ビームの全強度は n の本数に関わらず一定になるように設定した.作成 したモデル図と光源が照射されている範囲を Fig.7 に示す.





(b) Size of excitation source Fig.7 Simulation model

それぞれのモデルにおいて, 先端における強度と結 合効率を Fig.8 に示す.



(a) SPP intensity (n=6,9,12)



n=6,9 においては結合帯域の違いは大きく表れてい ないが, n=12 において若干狭帯域となることが確 認できた.また,1500 nm における結合効率は, n=6 のとき 0.06, n=9 のとき 0.04, n=6 のとき 0.01 とな った.溝数を増やすと,金表面を伝播する距離が長 くなることからプラズモンの伝播損失が増加する. n=12 での結合効率の低下の要因のひとつであると 考えられる.

3. 高効率化に向けた回折格子の設計 [2]

テーパー構造を用いた際, Fig.9 のφ方向に表面プ ラズモンが励起されるタイミングが異なるため, テ ーパーを伝搬する波面はゆがみ集光効率が悪くな る.そこで,ナノ集光の効率を向上させるための励 起光源と回折格子の設計を行った.



Fig.9 Straight grating

金テーパー先端におけるナノ集光の効率を向上さ せる方法は二つある。一つ目は,励起光源の波面を テーパーの曲率に合わせて整形し,先端部でのSPP の位相を揃える方法である.二つ目は,励起光源に 平面波を用いた場合,結合する位置によって生じる SPP の結合の時間差を調整するために,回折格子 の構造を湾曲させることで,先端部でのSPP の位 相を揃える方法である.まず前者について説明する.

(i) ナノ集光効率の向上に向けた波面の設計

ナノ集光効率の向上のため、金テーパーの曲率に 合わせた波面をもつ励起光源を設計した. Fig.10(a) は平面波励起で集光している四番目の回折格子の x-z面における電界強度のスナップショット,(b) 波 面整形で集光している四番目の回折格子の x-z 面に おける電界強度のスナップショットを示している. 先述した通り、回折格子の溝の周期P=1697 nm、溝 幅w=533 nm、溝の深さd=300 nm、溝の本数n=6 本 を用いている. この条件でシミュレーションを行い、 先端における強度を測定した.



Fig.10 Ideal wave front of the incident light field at tip surface (a) wave front of x-z side: plane wave

(b) wave front of x-z side: shaped wave

(ii) ナノ集光効率の向上に向けた回折格子の設計

波面のゆがみを修正するために,回折格子の形状 を伝搬する波面に沿った形にする湾曲回折格子を 設計した. Fig.6 の座標系で考えると,金テーパー を伝搬する波面の位相差ΔØは以下のように表され る[2].

 $\Delta \phi = k_{spp} \cdot r_{inc} - \{k_L \cdot sin\alpha \cdot (r_{inc} - rcos \phi) + k_{spp,r} \cdot r\}$ 上式において,右辺第一項は $\phi = 0$ のときの光路長, 右辺第二高は $\phi \neq 0$ のときの光路長を表している. 湾曲回折格子において発生する SPP の波面の ϕ 方 向の位相差 $\Delta \phi$ は $\phi = 0$ のときの光路長と $\neq 0$ のとき の光路長の差と等しい.一方,湾曲回折格子におけ る回折格子構造を設置する先端からの最適な位置 は,以下のように表される.

$$r_{gr}(\varphi) = r_{inc} \cdot \frac{k_{spp} - k_L \cdot sin\alpha}{k_{spp} - k_L \cdot sin\alpha \cdot cosq}$$

上式において, r_{inc} は励起位置, k_L は励起光の波数, k_{spp} は SPP の波数, α は先端角の半角である. 今回, 励起光の波数 k_L は中心波長 1500 nm とし, SPP の波 数 k_{spp} も励起光の中心波長 1500 nm で励起された SPP とした. 設計したモデルを Fig11 に示す.



Fig.11 Curved grating

4. シミュレーション結果

4.1 先端における強度比較

先述した三種類のモデルで先端における SPP スペクトルを Fig.12 に示す.1 は直線型回折格子(平面波励起),2は直線型回折格子(波面整形),3は湾曲型回折格子(平面波励起)である.



Fig.12 Spectra of the focused SPP pulses at the tip apex.

Fig.12より,直線型回折格子(波面整形)では直線 型回折格子(平面波励起)に比べて強度が 3.41 倍, 湾曲回折格子では 9.73 倍となり, 励起光源や回折 格子の形状を設計することで先端における強度が 大きくなることが確認できた. 強度が大きくなった 要因として,まず直線型回折格子(波面整形)と湾 曲回折格子に共通しているのは金テーパーを伝搬 する波面のずれが補正されたことが挙げられる. そ の中でも、2と3の結果を考察する.一点目は、回 折格子結合における違いである. φが小さいほど SPP の結合効率は高くなると考えられるが,2のモ デルでは回折格子上での x 方向のスポット径を大 きくしているため、 $\varphi = 0$ 付近でのエネルギー密度 が落ちてしまい, 強度が3よりも小さくなった. 二 点目は, テーパー先端付近における増強度の違いに ついてである. 1500 nm 帯 (長波長側) ではレイリ ー長さの影響が大きくなるため、2のモデルの特に 先端側でテーパーの曲率に沿った波面になってい ない可能性がある. 三点目は, 1500 nm 帯における SPP の実行屈折率の影響である. 1500 nm 帯では周 波数依存性は低いため,広い帯域で波面の揃った SPP を励起することができる 3 のモデルの設計で 用いるパラメータは先端角と SPP の実行屈折率で 決定されるため、3 では広帯域となったと考えられ る.

4.2 金テーパーを伝搬する SPP 強度の比較 [3]

三種類のモデルにおいて, 先端から 10 μm 地点 から先端に至るまでの SPP 強度を Fig.13 に示す. 強度に大きく変化が現れる先端付近においては 50 nm 間隔で, 先端から 10 μm から 4 μm までは 1 μm 間隔で測定点を設置し, 強度を測定した.



Fig.13 Enhancement of SPP Intensity from the grating to the tip apex for three gratings.

1 は直線型回折格子(平面波励起), 2 は直線型回折 格子(波面整形), 3 は湾曲型回折格子(平面波励起) である. 先端における強度の差が現れた要因として 挙げられるのは、金テーパーを伝搬する波面の影響 である. 先述したように, テーパーを伝搬すると波 面はゆがむため、先端での強度を大きくするために は、先端での位相が揃っている必要がある.励起光 源をテーパーに沿って設計した直線型回折格子(波 面整形)は、入射した光源が回折格子に到達するタ イミングが揃っているため,先端での位相のゆがみ が平面波励起に比べて補正され強度が大きくなっ たと考えられる.一方,湾曲回折格子の場合は,直 線型回折格子を用いた二つのモデルよりも先端か ら 10 µm 離れた位置から SPP 強度が大きい値を示 していた. 先端から離れた位置で強度の差が現れた 要因として挙げられるのは、回折格子の結合効率の 影響である. 直線型回折格子を用いている二つのモ デルに比べ,先端から 10 µm の地点で強度が大き くなった湾曲回折格子は四本目の回折格子に集光 した後,先端に向かって伝搬する波面に沿って回折 格子が湾曲しているため,それぞれの回折格子で発 生した SPP の強度が打ち消し合うことなく,損失 が抑えられ強度が大きくなったと推測される.先端 において強度に差が現れたのは直線型回折格子(波 面整形)と湾曲回折格子であるが,先端から離れた 位置から強度が大きくなった湾曲回折格子はさら に回折格子の結合効率の影響が重なり,三つのモデ ルの中で強度が最も大きくなったと考えられる.

4.3 金テーパーを伝搬する波面の比較

三種類のモデルにおいて, 先端から 15 μm 離れ た位置から先端へと伝搬する波面の様子を Fig.14 に示す。



(a) wave front of straight grating (plane wave)



(b) wave front of straight grating (shaped wave)



(c) wave front of curved grating (plane wave) Fig.11 wave front along the taper

Fig.14 より, (a)に比べて(b)と(c)のにおいて伝搬す る波面のゆがみが補正されていることを確認でき た.特に,湾曲回折格子においてその効果が大きく, 先端での位相が揃うため SPP 強度が大きくなった と考えられる.

5. まとめ

FDTD 法を用いたシミュレーションにより,金デ ーパーにおいて励起光源の中心波長 1500 nm が効 率的にナノ集光するような回折格子の最適なパラ メータを導いた.また,励起光源をテーパーの曲率 に沿って整形したモデル,回折格子を湾曲させたモ デルにおいて金テーパーを伝搬する波面のゆがみ を補正し,従来のテーパー上の回折格子のモデルに 比べて先端における強度がそれぞれ 3.41 倍,9.73 倍 となり,このようなモデルを作成することで集光効 率を向上させることを明らかにした.このような波 長帯における高強度かつ超高速ナノ光源は走査型 光学顕微鏡などへの応用が期待される.

References

- A. Giugni, B. Torre, A. Toma, M. Francardi,
 M. Malerba, A. Alabastri, R. Proietti Zaccaria,
 M. I. Stockman & E. Di Fabrizio, Nature Nanotech,
 8, 845–852 (2013)
- [2] S. Schmidt, P. Engelke, B. Piglosiewicz, M. Esmann, S. F. Becker, K. Yoo, N. Park, C. Lienau, and P. Gross, Opt. Express 21, 26564 (2013)
- [3] 藤間一憲,「金テーパーチップへの回折格子
 結合による超高速表面プラズモンのナノ集
 光」慶應義塾大学卒業論文(2012)